

MEMS Engineer Forum 2026

SMART Society Driven by MEMS

In-person(対面)開催

April 21-22, 2026

KFC Hall, Ryogoku, Tokyo, Japan

カンファレンス聴講料・技術展来場無料

技術展示出展のご案内

<https://www.m-e-f.info/>

本フォーラムは、21世紀のキーテクノロジーとされるMEMS技術の現状と、向こう10年までの技術の将来に迫る、この分野のキープレイヤーの中でもエンジニアを中心に運営されるユニークなフォーラムです。世界中のMEMS研究者、開発者、技術者が一堂に集うこのフォーラムは、2009年3月の初開催以降、回を重ね、MEF2026は第17回となります。

MEMSに関する基礎技術ならびに隣接分野の技術において、エンジニアならではの視点と技量で、新しいカタチを形成し、そして融合させて参ります。さらに融合の過程や完成に向かう姿を国際的なレベルで検証することをミッションとしております。

前回は2日間で14地域延べ930名のご参加を賜りました。MEFは参加費用は無料とし、スポンサーシップ・出展料によるご協力のもと運営しております。つきましては、MEF2026のスポンサーシップならびに展示会の出展を募集いたします。今回は前回に引き続き、2Fと3Fの展示会場となる予定です。ブースの位置は、種別、お申込み日を鑑み、事務局にて調整させていただきます。是非ご協賛を賜れますようお願い致します。



MEF 2026の講師陣

By alphabetical order of last name

世界のMEMS分野を中心とした著名な技術研究者、経営トップ層々の講演陣が集います。それがMEFの特徴です
Palvi Apilo, TactoTek, Finland

Pierre Damien Berger, CEA LETI, France

Matthijn Dekkers, Lam Research, USA

Stefan Ernst, Xfab, Germany

Weiliun Fang, National Tsing Hua University, Taiwan

Tino Fuchs, Robert Bosch GmbH, Germany

Suryaprakash Ganti, Frore Systems, USA

Kazuyuki Higashi, NuFlare Technology, Inc., Japan

Shigeto Iwai, Yokogawa Electric Corp., Japan

Jerome Mouly, Yole Group, France

Hiroshi Suzuki, Syntiant Japan K.K., Japan

Mika Takahashi, IDtechEx, U.K.

Patrick Turner, Resonant Inc., a Murata Company, USA

Yao Zhu, Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), Singapore

TBA, QST Corporation Limited, China

More speakers are coming.....

出展者特典 (金額は税別)

	一般企業	アカデミック	ベンチャー企業
	¥300,000	¥60,000	¥60,000

企業PRの支援	招待・優待	一般企業	アカデミック	ベンチャー企業
1 出展者プレゼンテーション (4分予定) 利用		○	×	○
2 MEF予稿集 (デジタル版) への広告掲載		1頁○	1頁○	1頁○
3 MEFウェブサイトへのロゴ掲載		○	○	○
4 MEFセッション・展示会場内にロゴ掲載		○	○	○
5 1-minute PR動画上映 (ランチ休憩時会場放映)		○	×	○
6 懇親会への招待(初日)	1名様*		×	×
7 昼食券 (2日間)	2名様*		×	×
8 VIPルーム使用权		○	○	○
9 登録者リスト (共有承諾分のみ、会期後提供)		○	×	×

*2026年1月31日までに申し込みの場合は、招待枠・昼食券が2倍になります
申込締切日: 2026年2月28日

MEF 国際諮問委員会 (区分別氏名ABC順)

委員長 桑野 博喜 東北大学
副委員長 江刺 正喜 東北大学
副委員長 神永 晋 東レ株式会社/
SKグローバルアドバイザーズ
副委員長 小林 直人 早稲田大学
委員 Jean-Christophe Eloy Yole Developpement
委員 Weilun Fang National Tsing Hua Univ.
委員 Udo-Martin Gómez Robert Bosch
委員 Thomas Kenny Stanford University
委員 Xinxin Li Shanghai Institute of
Microsystem & Information
Technology
委員 宮島 博志 住友精密工業
委員 野々村 裕 元名城大学
委員 Kurt Petersen Silicon Valley Band of Angels

MEF組織委員会 (区分別氏名ABC順)

委員長 田中 秀治 東北大学
副委員長 安藤 妙子 立命館大学
委員 赤羽 優子 株式会社ティ・ディ・シー
委員 日暮 栄治 東北大学
委員 廣瀬 真樹 浜松ホトニクス株式会社
委員 飯田 淳 TDK株式会社
委員 稲子 みどり HOLST Centre Japan
委員 石田 博之 ズース・マイクロテック株式会社
委員 古賀 章浩 キヤノンメディカルシステムズ株式会社
委員 金子 亮介 横河電機株式会社
委員 小柳 治 株式会社日本企業成長投資
委員 口地 博行 日清紡マイクロデバイス株式会社
委員 三田 正弘 株式会社協同国際ナショナル
委員 三宅 亮 東京大学
委員 大高 剛一 東北大学
委員 奥良 彰 ローム株式会社
委員 澤田 和明 豊橋技術科学大学
委員 積 知範 オムロン株式会社
委員 菅 千絵子 SPPテクノロジー株式会社
委員 嶋島 武尚 株式会社アルファドライブ
委員 土屋 智由 京都大学
委員 梅田 圭一 株式会社村田製作所
委員 和戸 弘幸 株式会社ミライズ テクノロジーズ
委員 山西 陽子 九州大学

一般企業展示

サイズ W1800mm × D900mm × H2100mm
(展示台高さ: 700mm)

基礎小間には以下を基本パッケージとします。

- ・バックパネル (画紙、フックのみ使用可)
- ・社名板 (スミ1色、統一書体)
- ・展示台 (テーブルクロス、スカート布付)
- ・コンセント 500W (2口付き)
- ・椅子 1脚

アカデミック展示・ベンチャー企業展示

サイズ W1800mm × D450mm × H1800mm
(展示台高さ: 700mm)

- ・バックパネル (画紙、フックのみ使用可)
- ・社名板 (スミ1色、統一書体)
- ・基礎小間サイズ幕板付長机
- ・椅子 1脚

*アカデミック・ベンチャー展示は電源が必要な場合有料 (6000円税別) となります

*ベンチャー展示: 新しい視点や独自の能力・技術で革新的なサービスを提供する、原則 設立5年以内の企業を対象とします。

MEF事務局 (株)セミコンダクタポータル

mef_2026@semiconportal.com

Tel: 03-6807-3970

